## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-185275

(43)Date of publication of application: 09.07.1999

(51)Int.CI.

G11B 7/125

G11B 7/00

(21)Application number: 09-365081

(71)Applicant : RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

19.12.1997

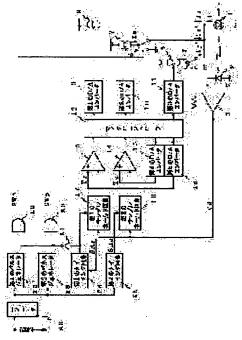
(72)Inventor: SHIGEMORI TOSHIHIRO

## (54) LASER POWER CONTROLLER FOR OPTICAL DISK DRIVE UNIT

### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To stabilize the outgoing light quantity of a laser diode while using an outgoing light detector whose detecting band is relatively narrow and which is of inexpensive by adjusting the current of a first level to be applied on a laser diode according to the output of a first sample-and-hold means and adjusting currents of second and third levels according to the output of a second sample-and-hold means. SOLUTION: A timing signal SHr is made to be generated making on/off control signals SWe, SWp of Ie, Ip switches 6, 4 to be in an off-state for a prescribed period in order to enable the correct light quantity detection of a laser diode 1 and the outgoing light quantity detection voltage Vd of an amplifier 3 is held in a first sample-and-hold circuit 17 in the period of the timing signal SHr. Moreover, the outgoing light quantity detection voltage Vd being in a period the control signals SWe, SWp are respectively in an on- state, off-state is

held in a second sample-and-hold means 18. Then, a



microcontroller 12 adjusts Ir, Ie. Ip current sources 8, 7, 5 according to outputs of the circuits 17, 18.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.08.2002

[Date of sending the examiner's decision of

24.02.2004

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision 2004-06096

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 25.03.2004 decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-185275

(43)公開日 平成11年(1999)7月9日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup> G 1 1 B 酸別記号

FΙ

G11B 7/125

С

7/125 7/00

7/00

L

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 16 頁)

(21)出願番号

特願平9-365081

(71) 出願人 000006747

株式会社リコー

(22)出願日

平成9年(1997)12月19日

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 重森 俊宏

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

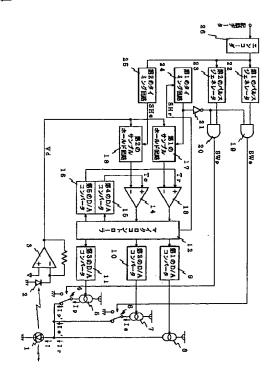
会社リコー内

#### (54) 【発明の名称】 光ディスク駆動装置のレーザパワー制御装置

### (57)【要約】

【課題】 検出帯域が比較的狭く、安価な出射光量検出 器を使用する簡単な構成によって、レーザダイオードの 出射光量を安定化させると共に、信頼性の高い情報の記 録を可能にする。

【解決手段】 光源にIrを印加する手段、IrにIeを重畳する手段、IrとIeにIpを重畳する手段、Ieをオン/オフするスイッチSW1、Ipをオン/オフするスイッチSW2、記録コードに応じスイッチSW1にオン/オフ信号SWeを与えるパルス発生手段、記録コードに応じスイッチSW2にオン/オフ信号SWpを与えるパルス発生手段、SWe,SWpの出力を所定期間オフ状態とするタイミング信号SHrを発生する手段、SHrの発生期間中の光量検出出力を保持する手段SH1、SWeがオン状態でSWpがオフ状態の期間中の光量検出出力を保持する手段SH2の出力に応じIrを調整する第1調整手段、手段SH2の出力に応じIeを調整する第1調整手段、手段SH2の出力に応じIpを調整する第3調整手段を設ける。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体レーザ等の光源と、前記光源の出射光量を検出する光量検出手段とを備え、前記光源から出射される光量を記録コード周波数より高い周波数のパルス列として光ディスク上に照射して情報の記録、消去、初期化を行う光ディスク駆動装置において、レーザパワー制御装置として、

前記光源に第1レベルの電流を印加する電流印加手段 と

前記第1レベルの電流に第2レベルの電流を重畳する第 10 1電流重畳手段と、

前記第1レベルの電流と第2レベルの電流に第3レベル の電流を重畳する第2電流重畳手段と、

前記第2レベルの電流をオン/オフ制御する第1スイッチ手段と、

前記第3レベルの電流をオン/オフ制御する第2スイッチ手段と、

記録コードに応じて、前記第1スイッチ手段にパルス状 の第1のオン/オフ制御信号を与える第1のパルス発生 手段と、

記録コードに応じて、前記第2スイッチ手段にパルス状の第2のオン/オフ制御信号を与える第2のパルス発生手段と、

前記第1と第2のオン/オフ制御信号の出力を所定期間 オフ状態とするタイミング信号を発生するタイミング手 段と、

前記タイミング信号の発生期間中の前記光量検出手段の 出力を保持する第1のサンプルホールド手段と、

前記第1のオン/オフ制御信号がオン状態で、前記第2のオン/オフ制御信号がオフ状態の期間中の前記光量検 30出手段の出力を保持する第2のサンプルホールド手段

前記第1のサンプルホールド手段の出力に応じて、前記 第1レベルの電流を調整する第1調整手段と、

前記第2のサンプルホールド手段の出力に応じて前記第 2レベルの電流を調整する第2調整手段と、

前記第2のサンプルホールド手段の出力に応じて前記第3レベルの電流を調整する第3調整手段、とを備えたことを特徴とする光ディスク駆動装置。

【請求項2】 請求項1の光ディスク駆動装置において、

第1調整手段は、第1の所定レベル信号と第1のサンプルホールド手段の出力レベルとを比較し、比較結果に応じて第1レベルの電流を増減させ、

第2調整手段は、第2の所定レベル信号と第2のサンプルホールド手段の出力レベルとを比較し、比較結果に応じて第2レベルの電流を増減させることを特徴とする光ディスク駆動装置。

【請求項3】 請求項2の光ディスク駆動装置において、

第3調整手段は、第3レベルの電流が、第2調整手段によって調整された第2レベルの電流に比例した値となるように調整することを特徴とする光ディスク駆動装置。 【請求項4】 請求項1の光ディスク駆動装置において、

2

第2のサンプルホールド手段は、第1のオン/オフ制御信号がオン状態で、第2のオン/オフ制御信号がオフ状態の期間が所定期間以上となる期間中の光量検出手段の出力を保持することを特徴とする光ディスク駆動装置。

【請求項5】 請求項1の光ディスク駆動装置において、

第2のサンプルホールド手段は、第1のオン/オフ制御信号がオン状態で、第2のオン/オフ制御信号がオフ状態の内、記録コードの最長反転期間に相当する期間の光量検出手段の出力を保持することを特徴とする光ディスク駆動装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、光源から出射される光量を記録コード周波数より高い周波数のパルス列として光ディスク上に照射して情報の記録、消去、初期化を行う光ディスク駆動装置に係り、特に、光源の半導体レーザ(レーザダイオード)等の発光パワーを制御するレーザパワー制御装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】CD-RW(コンパクトディスク・リライタブル)などの相変化型光ディスクは、高密度記録が可能なディスクであり、情報の記録、消去、初期化が行われている。また、この相変化型光ディスクの情報の記録方法については、各種の方式が提案されている。例えば、オーバライトを行うのに適する情報の記録方法として、ディスク上に非晶質化マークを形成するために、レーザビームを短い単一または複数のパルスで照射したり(特開昭63-266632号公報)、同様に、ディスク上に非晶質化マークを形成するため、あるいは結晶化するために、高い周波数のパルス列でレーザビームを照射する(特開平1-119921号公報)などの記録方法が知られている。ここで、相変化型光ディスクにおける記録方法について、簡単に説明する。

40 【0003】図9は、相変化型光ディスクにおける記録方法の原理を説明する図で、(1) は記録情報とレーザパワーとの関係、(2) は記録情報に対応するトラック上の記録状態を示す。図において、Ppは非晶質化レベル、Peは結晶化レベル、Prは読み出しレベルを示す。

【0004】相変化型光ディスクの場合、情報の記録に際しては、ディスクのトラック上にレーザスポットを照射し、レーザパワーを記録情報に応じて変化させることにより、ディスクの記録膜上に結晶化領域と非晶質化したマークを形成することによって行われる。この状態

50 を、図9(1) に示しており、記録コード(情報コード)

の「0」のレベルに対応して、レーザパワーを結晶化レ ベルPeとすることにより、記録膜が結晶化されて、結 晶化領域が形成される。

【0005】これに対して、記録コードの「1」のレベ ルに対応して、レーザパワーを非晶質化レベルPpと読 み出しレベルPrとの間で、パルス状に変化させること により、記録膜が非晶質化されて、非晶質化マークが形 成される。このような記録動作によって、図9(2)に示 したように、トラック上に記録コードの「1」のレベル に対応する非晶質化マークが形成される。ここで、3つ 10 のレベルの関係は、Pp(非晶質化レベル)>Pe(結 晶化レベル)>Pr (読み出しレベル)である。

【0006】このようにして、相変化型光ディスクに は、記録コードの「0」のレベルに対応する結晶化領域 と、記録コードの「1」のレベルに対応する非晶質化マ ークとが形成される。そのため、レーザパワーとして は、記録コードの「0」のレベルに対応する(中間の) 結晶化レベルPeと、記録コードの「1」のレベルを形 成するための(最高の)非晶質化レベルPpと、(最低 の) 読み出しレベルPr、の計3つのレベルで制御する 必要がある。

【0007】ところで、CD-RWなどの相変化型光デ ィスクのように、レーザスポットを高い周波数のパルス 列として光ディスク上に照射して情報の記録あるいは消 去、初期化を行う光ディスク駆動装置においては、レー ザパワーの変化も高周波であり、高速になる。そのた め、検出帯域の限られた出射光量検出器を使用すると、 正確な出射光量を検出することが困難になる。そして、 このような不正確に検出された出射光量に基いて出射光 量を調整しても、光量の正確な調整は難かしいので、安 30 定化させることも困難である。その結果、情報の記録、 消去、初期化等の処理が不完全なものになる、というケ ースが生じる。また、正確な出射光量を検出するため に、広帯域の出射光量検出器を使用すると、高価な受光 素子やアンプ等を必要とするのでコストアップになる。 【0008】このような不都合を解決する方法として、 この出願の発明者は、安価で簡単な構成によって、レー ザダイオードの出射光量を安定化させることにより、情 報の信頼性の高い光ディスク駆動装置について提案した (特開平9-171631号公報)。この光ディスク駅 40 動装置のレーザパワー制御装置では、光源を非パルス状 に駆動する期間を設け、この期間中にレーザの発光パワ ーを検出して、発光パワーを制御するようにしている。 このように発光パワーを制御すれば、検出帯域の限られ た出射光量検出器を使用しても、正確な出射光量の検出 が可能である。

【0009】しかし、レーザダイオードの発光パワーの 検出において、非パルス状の期間のレーザダイオードは 記録パワー(前記の非晶質化レベル: Pp) であり、こ

ワーの制御を行うと、光ディスクが劣化する、という問 題があり、相変化型光ディスクにおいては、非パルス状 の光の記録パワーによる照射は、光ディスクの特性を著 しく劣化させるので、情報の信頼性の高いデータの記 録、再生あるいは消去が行えない、という問題を生じ る。そこで、中間レベルの結晶化レベルPeのパワー制 御(設定)は、記録情報が「0」の非パルス状の期間に 行って、最適な結晶化レベルPeの重畳電流Ieを検出 し、最適な非晶質化レベルPpの重畳電流Ipは、非パ ルス状の期間に検出された結晶化レベルPeの重畳電流 Ieに比例した値の電流に調整することにより設定し、 読み出しレベルPrの駆動電流Irは、ローパスフィル タによって平滑化された検出出力を使用して、非晶質化 レベルPpと最も低い読み出しレベルPrとの平均パワ ーレベルを検知することによって設定する光ディスク駆 動装置のレーザパワー制御装置について、すでに提案し た(特開平9-288840号公報)。このように、パ ルス状オン/オフ期間におけるローパスフィルタの出力 を検出して発光パワーを制御することによって、検出帯 域が比較的狭くて安価な出射光量検出器を使用しても、 正確なパワー制御が可能になる。

#### [0010]

【発明が解決しようとする課題】先の従来の技術で説明 したように、検出帯域が比較的狭くて安価な出射光量検 出器を使用しても、正確なパワー制御が可能な光ディス ク駆動装置のレーザパワー制御装置は、すでに知られて いる。しかし、光源を非パルス状に駆動する期間を設 け、この期間中にレーザの発光パワーを検出して、発光 パワーを制御する光ディスク駆動装置(前出の特開平9 -171631号公報) や、パルス状オン/オフ期間に おけるローパスフィルタの出力を検出して発光パワーを 制御する光ディスク駆動装置(前出の特開平9-288 840号公報)では、出射光量検出と、正確な出射光量 の制御のための回路がやや複雑であり、改良の余地があ る。この発明では、レーザスポットを記録周波数より高 い周波数のパルス列として光ディスク上に照射して情報 の記録、再生、消去あるいは初期化を行う光ディスク装 置において、検出帯域が比較的狭く、安価な出射光量検 出器を使用する簡単な構成によって、レーザダイオード の出射光量を安定化させると共に、信頼性の高い情報の 記録を可能にすることを課題としている(請求項1から 請求項5の発明)。

### [0011]

【課題を解決するための手段】請求項1の光ディスク駆 動装置は、レーザパワー制御装置として、光源に第1レ ベルの電流を印加する電流印加手段と、第1レベルの電 流に第2レベルの電流を重畳する第1電流重畳手段と、 第1レベルの電流と第2レベルの電流に第3レベルの電 流を重畳する第2電流重畳手段と、第2レベルの電流を のように高い発光パワーを光ディスクに照射して発光パ 50 オン/オフ制御する第1スイッチ手段と、第3レベルの

電流をオン/オフ制御する第2スイッチ手段と、記録コ ードに応じて第1スイッチ手段にパルス状の第1のオン /オフ制御信号を与える第1のパルス発生手段と、記録 コードに応じて第2スイッチ手段にパルス状の第2のオ ン/オフ制御信号を与える第2のパルス発生手段と、第 1と第2のオン/オフ制御信号の出力を所定期間オフ状 態とするタイミング信号を発生するタイミング手段と、 タイミング信号の発生期間中の光量検出手段の出力を保 持する第1のサンプルホールド手段と、第1のオン/オ フ制御信号がオン状態で第2のオン/オフ制御信号がオ フ状態の期間中の光量検出手段の出力を保持する第2の サンプルホールド手段と、第1のサンプルホールド手段 の出力に応じて第1レベルの電流を調整する第1調整手 段と、第2のサンプルホールド手段の出力に応じて第2 レベルの電流を調整する第2調整手段と、第2のサンプ ルホールド手段の出力に応じて第3レベルの電流を調整 する第3調整手段とを有している。

【0012】請求項2の光ディスク駆動装置は、請求項 1の光ディスク駆動装置において、第1調整手段が、第 1の所定レベル信号と第1のサンプルホールド手段の出 20 カレベルとを比較し、比較結果に応じて第1レベルの電 流を増減させ、第2調整手段が、第2の所定レベル信号 と第2のサンプルホールド手段の出力レベルとを比較 し、比較結果に応じて第2レベルの電流を増減させるよ うにしている。

【0013】請求項3の光ディスク駆動装置は、請求項 2の光ディスク駆動装置において、第3調整手段は、第 3レベルの電流が、第2調整手段によって調整された第 2レベルの電流に比例した値となるように調整する。 【0014】請求項4の光ディスク駆動装置は、請求項 30

1の光ディスク駆動装置において、第2のサンプルホー ルド手段が、第1のオン/オフ制御信号がオン状態で、 第2のオン/オフ制御信号がオフ状態の期間が所定期間 以上となる期間中の光量検出手段の出力を保持するよう にしている。

【0015】請求項5の光ディスク駆動装置は、請求項 1の光ディスク駆動装置において、第2のサンプルホー ルド手段が、第1のオン/オフ制御信号がオン状態で、 第2のオン/オフ制御信号がオフ状態の内、記録コード の最長反転期間に相当する期間の光量検出手段の出力を 40 保持するようにしている。

### [0016]

【発明の実施の形態】第1の実施の形態

この第1の実施の形態は、請求項1の発明に対応してい るが、請求項2から請求項5の発明にも関連しており、 請求項1の発明が基本発明である。この第1の実施の形 態では、検出帯域が比較的狭くて安価な出射光量検出器 を使用した簡単な構成によって、レーザダイオードの出 射光量を安定化させることにより、3つのパワーレベル の設定、すなわち、最も低い読み出しレベルPrだけで 50 D/Aコンバータ16から出力される所定電圧、Teは

なく、中間の結晶化レベルPeや、最も高い非晶質化レ ベルPpの正確な制御を可能にしており、特に、結晶化 レベルPeの駆動時には、読み出しレベルPrの電流I rに結晶化レベルPeの電流Ieを重畳し、非晶質化レ ベルPpの駆動時には、読み出しレベルPrの電流Ir と結晶化レベルPeの電流Ieに、非晶質化レベルPp の電流Ipを重畳する点に特徴を有している。

【0017】具体的にいえば、第1の実施の形態では、 情報コード C が「1」レベルの期間のパルス状の発光部 分でも、正確な光量検出を可能にするために、結晶化レ ベルPeの電流Ieのオン/オフ制御信号(後出の図1 のSWe)と非晶質化レベルPpの電流Ipのオン/オ フ制御信号(SWp)の出力を所定期間オフ状態とする タイミング信号(SHr)を発生させ、このタイミング 信号(SHr)の発生期間中に、出射光量検出電圧(V d)を第1の回路で保持し、また、電流 I e のオン/オ フ制御信号(SWe)がオン状態で、電流Ipのオン/ オフ制御信号(SWp)がオフ状態の期間中の出射光量 検出電圧(Vd)を第2の回路で保持する。そして、先 の第1の回路に保持された値に応じて、読み出しレベル Prの電流 Irを調整し、第2の回路に保持された値に 応じて、結晶化レベルPeの電流Ieと非晶質化レベル P pの電流 I pを調整する。最初に、全体の構成を説明 する。

【0018】図1は、この発明の光ディスク駆動装置に ついて、そのレーザパワー制御装置の要部構成の実施の 形態の一例を示す機能ブロック図である。図において、 1はレーザダイオード、2はフォトディテクタ、3はア ンプ、4はIpスイッチ、5はIp電流源、6はIeス イッチ、7はIe電流源、8はIr電流源、9~11は 第1から第3のD/Aコンバータ、12はマイクロコン トローラ、13と14は第1と第2のコンパレータ、1 5と16は第4と第5のD/Aコンバータ、17と18 は第1と第2のサンプルホールド回路、19と20は第 1と第2のアンドゲート回路、21はインバータ、22 と23は第1と第2のパルスジェネレータ、24と25 は第1と第2のタイミング回路、26はエンコーダを示 し、 I は実際にレーザダイオード1に印加される電流、 Irは読み出しレベルPrの駆動電流、Ieは結晶化レ ベルPeとするために電流Irに重畳する電流で、I e'は電流Ieがスイッチングされた電流、Ipは非晶 質化レベルPpとするために電流Irと電流Ieに重畳 する電流で、 Ір′は電流 Ірがスイッチングされた電 流、Cは情報コード(記録コード)、SWeはIeスイ ッチ6のオン/オフ制御信号、SWpはIpスイッチ4 のオン/オフ制御信号、SH r は第1のタイミング回路 24から出力される第1のサンプルホールド回路17の サンプルタイミング信号、SHeは第2のサンプルホー ルド回路18のサンプルタイミング信号、Trは第5の

第4のD/Aコンバータ15から出力される所定電圧、 Vdはアンプ3の出射光量検出電圧を示す。

【0019】レーザダイオード1の出射光は、図示しな いレンズにより集光されてディスク上に照射されるが、 この出射光の一部は、フォトディテクタ2にも照射され て、その出力がアンプ3により増幅され、出射光量の検 出に用いられる。このレーザダイオード1には、3つの 電流源(Ip電流源5, Ie電流源7, Ir電流源8) からの電流が印加されるが、その内の2つの電流源(1. p電流源5, Ie電流源7)からの電流は、Ipスイッ チ4とIeスイッチ6によってそれぞれオン/オフされ る。まず、І г電流源8は、レーザダイオード1に対し て、レーザパワーを読み出しレベルPrにするために必 要な電流 Irを印加する(最低のレベル)。次に、結晶 化レベルPeの駆動時には、Ipスイッチ4とIeスイ ッチ6の2つのスイッチの内、 I e スイッチ6のみが動 作され、Ieスイッチ6がオン時には、Ir電流源8か らの電流 Irと Ie電流源7からの電流 Ieが、レーザ ダイオード1に印加される。

【0020】この場合には、このIe電流源7からの電 20 流 I e は、 I e スイッチ6によってオン/オフ制御され た電流 I e'として、読み出しレベル P r の電流 I r に 重畳される形でレーザダイオード1に印加される。した がって、この結晶化レベルPeの駆動時には、レーザパ ワーを結晶化レベルPeとするために必要な電流Ir+ Ie'が、レーザダイオード1に印加される(中間のレ ベル)。また、非晶質化レベルPpの駆動時には、先の 結晶化レベルPeの電流Ir+Ieに、Ip電流源5か らの電流 I pが重畳される形でレーザダイオード1に印 加される。すなわち、この場合には、Ieスイッチ6と Ipスイッチ4が動作され、Ieスイッチ6とIpスイ ッチ4とが共にオンのときには、Іг電流源8からの電 流Irに、Ie電流源7からの電流IeとIp電流源5 からの電流 Ірとが重畳されて、電流 Іг+ Іе+ Ір がレーザダイオード1に印加される。

【0021】他方、Ieスイッチ6とIpスイッチ4とが共にオフのときは、Ir電流源8からの電流Irのみが、レーザダイオード1に印加される。このIp電流源5からの電流は、Ipスイッチ4によってオン/オフ制御されたスイッチング電流Ip'として、結晶化レベルPeの電流Ir+Ieに重畳される形でレーザダイオード1に印加される。したがって、この非晶質化レベルPpの駆動時には、読み出しレベルPrの電流Irに、(結晶化レベルPeの駆動時の)Ieスイッチ6のオン

(結晶化レベルPeの駆動時の)Ieスイッチ6のオン/オフにより生成されたスイッチング電流Ie'と、Ipスイッチ4のオン/オフにより生成されたスイッチング電流Ip'とが重畳された電流Ir+Ie'+Ip'が、レーザダイオード1に印加される(最高のレベル)。

【0022】すでに述べたように、この第1の実施の形 50

態では、結晶化レベルPeの駆動時には、読み出しレベルPrの電流Irに結晶化レベルPeの電流Ieを重畳し、非晶質化レベルPpの駆動時には、読み出しレベルPrの電流Irと結晶化レベルPeの電流Ieに、非晶質化レベルPpの電流Ipを重畳することによって、フォトディテクタ、検出アンプの帯域が限られている場合でも、読み出しレベルPr、結晶化レベルPe、非晶質化レベルPpの各出射レーザパワーが正確に検出できるようにしている。次に、第1の実施の形態による動作を、タイミングチャートによって詳しく説明する。

【0023】図2は、図1に示した光ディスク駆動装置について、その動作を説明するタイミングチャートである。図の各波形に付けられた符号は図1の符号位置に対応しており、Pは電流Iによるレーザパワー、期間aは情報コードCが「0」レベルの期間、期間bは情報コードCが「1」レベルの期間、期間cはサンプルタイミング信号S H r が「H」となる期間を示す。

【0024】最初に、情報コードの「0」レベルに対応するレーザパワー(図2のP)の結晶化レベルPeの制御と、情報コードの「1」レベルに対応する非晶質化レベルPpの制御(非晶質化レベルPpと読み出しレベルPrとの間でパルス状に変化させるパワー制御)について述べる。先の図1の光ディスク駆動装置において、記録データは、エンコーダ26によって所定のデータ変調が行われ、情報コード(記録コード)Cに変換される。データ変調の方式として、CD-RWなどの相変化型光ディスクでは、一般にEFM変調が使用される。

【0025】第1のパルスジェネレータ22と第2のパルスジェネレータ23は、情報コードCのレベルに応じてオン/オフ動作を行う。この第1と第2のパルスジェネレータ22、23のオン/オフ動作により、Ieスイッチ6のオン/オフ制御信号SWeとIpスイッチ4のオン/オフ制御信号SWpとが生成されるが、そのために、第1のパルスジェネレータ22と第2のパルスジェネレータ23の出力側には、第1のアンドゲート回路19と第2のアンドゲート回路20がそれぞれ接続されている。

【0026】第1のパルスジェネレータ22の出力は、第1のアンドゲート回路19の一方に入力され、また、第2のパルスジェネレータ23の出力は、第2のアンドゲート回路20の一方に入力される。また、第1のアンドゲート回路19と、第2のアンドゲート回路20の他方の入力には、インバータ21を介して、通常「H」の信号が与えられている。したがって、通常、第1のパルスジェネレータ22と第2のパルスジェネレータ23の出力が、そのまま2つのオン/オフ制御信号SWeと、Ipスイッチ4のオン/オフ制御信号SWpとして出力される。

【0027】まず、情報コードCが「0」レベルの期間

(図2の期間 a)では、一方の第1のパルスジェネレータ22から出力される制御信号SWeは「H」レベル、他方の第2のパルスジェネレータ23から出力される制御信号SWpは「L」レベルとなる。そのため、Ieスイッチ6だけがオン状態となり、レーザダイオード1に印加される電流Iとして、Ir電流源Bからの電流IrとIe電流源Tからの電流Ieの、Ir+Ieが供給される。したがって、レーザダイオード1のレーザパワー(出射パワー)Pは、結晶化レベルPeとなる。

【0028】次に、情報コードCが「1」レベルの期間 (図2の期間b)では、第1のパルスジェネレータ22 と第2のパルスジェネレータ23からの出力は、同じタ イミングでパルス状に変化する。そのため、この場合に は、2つのオン/オフ制御信号SWe, SWpも、同じ タイミングでパルス状に変化され、 Ie スイッチ 6 およ び I pスイッチ 4 は、同時にパルス状にオン/オフ動作 を行う。すなわち、この図2の期間 b は、レーザダイオ ード1には、両スイッチ6、4がオフのときには電流 I rが、両スイッチがオンのときには電流Ir+Ie+I pが印加されることになる。したがって、レーザダイオ ード1のレーザパワー(出射パワー) Pは、読み出しレ ベルPrと非晶質化レベルPpとの間でパルス状に変化 される。以上の動作により、図1の光ディスク駆動装置 によれば、情報コードの「0」レベルに対応して、レー ザパワー(図2のP)を結晶化レベルPeに制御し、情 報コードの「1」レベルに対応して、レーザパワーを非 晶質化レベルPpと読み出しレベルPrとの間でパルス 状に変化させるパワー制御(非晶質化レベルPpの制 御)が実現される。

【0029】ところで、アンプ3の光量検出電圧Vd は、レーザパワーPに比例した値となるが、フォトディ テクタ2、アンプ3の応答帯域が限られているため、情 報コードCが「1」レベルの期間(期間b)のパルス状 の発光部分では、正確な光量検出ができない。なお、情 報コードCが「O」レベルの期間(期間a)では、レー ザパワーPは結晶化レベルPeであり、非パルス状とな るため、光量検出電圧Vdは、図2のVdに示すよう に、結晶化レベルPeに比例した値となる。そこで、こ の第1の実施の形態では、情報コードCが「1」レベル の期間(期間b)のパルス状の発光部分でも、正確な光 40 量検出を可能にするために、Ieスイッチ6のオン/オ フ制御信号SWeと、Ipスイッチ4のオン/オフ制御 信号SWpの出力を所定期間オフ状態とするタイミング 信号SHrを発生させて、このタイミング信号SHrの 発生期間中に、アンプ3の出射光量検出電圧Vdを第1 のサンプルホールド回路17によって保持する。また、 Ieスイッチ6のオン/オフ制御信号SWeがオン状態 で、Ipスイッチ4のオン/オフ制御信号SWpがオフ 状態の期間中のアンプ3の出射光量検出電圧Vdを、第 2のサンプルホールド回路18によって保持する。

【0030】そして、第1のコンパレータ13とマイク ロコントローラ12と第1のD/Aコンバータ9によ り、第1のサンプルホールド回路17の出力に応じて、 I r 電流源8からの電流 I r を調整する。また、第2の コンパレータ14とマイクロコントローラ12と第2の D/Aコンバータ10により、第2のサンプルホールド 回路18の出力に応じて、 Ie電流源7からの電流 Ie を調整すると共に、第2のコンパレータ14とマイクロ コントローラ12と第3のD/Aコンバータ11によ り、第2のサンプルホールド回路18の出力に応じて1 p電流源5からの電流 I pを調整するように構成してい る。この場合の各電流 Ir, Ie, Ipの調整動作につ いては、第2から第5の実施の形態で具体的に説明す る。この第1の実施の形態では、以上のように構成する ことによって、検出帯域が比較的狭くて安価な出射光量 検出器を使用しても、レーザダイオードの出射光量を安 定化させることが可能になるので、情報の信頼性の高い 光ディスク駆動装置が実現される。

10

【0031】ここで、この第1の実施の形態(請求項1 の発明)の光ディスク駆動装置を、図1の装置の構成と 対照すると、次のようになる。半導体レーザ等の光源 (図1のレーザダイオード1)と、前記光源(レーザダ イオード1)の出射光量を検出する光量検出手段(フォ トディテクタ2、アンプ3)とを備え、前記光源(レー ザダイオード1)から出射される光量を記録コード周波 数より高い周波数のパルス列として光ディスク上に照射 して情報の記録、消去、初期化を行う光ディスク駆動装 置において、レーザパワー制御装置として、前記光源 (レーザダイオード1) に第1レベルの電流(Ir)を 印加する電流印加手段(Ir電流源8)と、前記第1レ ベルの電流(Ir)に第2レベルの電流(Ie)を重畳 する第1電流重畳手段(Ie電流源7)と、前記第1レ ベルの電流(Ir)と第2レベルの電流(Ie)に第3 レベルの電流(Ip)を重畳する第2電流重畳手段(I p電流源5)と、前記第2レベルの電流(Ie)をオン /オフ制御する第1スイッチ手段(Ieスイッチ6) と、前記第3レベルの電流(Ip)をオン/オフ制御す る第2スイッチ手段(Ipスイッチ4)と、記録コード に応じて、前記第1スイッチ手段(Ieスイッチ6)に パルス状の第1のオン/オフ制御信号(SWe)を与え る第1のパルス発生手段(第1のパルスジェネレータ2 2)と、記録コードに応じて、前記第2スイッチ手段 (Ipスイッチ4)にパルス状の第2のオン/オフ制御 信号(SWp)を与える第2のパルス発生手段(第2の パルスジェネレータ23)と、前記第1と第2のオン/ オフ制御信号(SWe.SWp)の出力を所定期間オフ 状態とするタイミング信号(SHr)を発生するタイミ ング手段(第1のタイミング回路24,第1のアンドゲ ート回路19,第2のアンドゲート回路20)と、前記 50 タイミング信号(SHr)の発生期間中の前記光量検出

手段(フォトディテクタ2、アンプ3)の出力(Vd) を保持する第1のサンプルホールド手段(第1のサンプ ルホールド回路17)と、前記第1のオン/オフ制御信 号(SWe)がオン状態で、前記第2のオン/オフ制御 信号(SWp)がオフ状態の期間中の前記光量検出手段 (フォトディテクタ2, アンプ3) の出力(Vd)を保 持する第2のサンプルホールド手段(第2のサンプルホ ールド回路18)と、前記第1のサンプルホールド手段 (第1のサンプルホールド回路17)の出力に応じて、 前記第1レベルの電流(Ir)を調整する第1調整手段 10 (第1のコンパレータ13,マイクロコントローラ1 2, 第1のD/Aコンバータ9)と、前記第2のサンプ ルホールド手段(第2のサンプルホールド回路18)の 出力に応じて前記第2レベルの電流 (Ie) を調整する 第2調整手段(第2のコンパレータ14、マイクロコン トローラ12, 第2のD/Aコンバータ10)と、前記 第2のサンプルホールド手段(第2のサンプルホールド 回路18)の出力に応じて前記第3レベルの電流(I p) を調整する第3調整手段(第2のコンパレータ1 4, マイクロコントローラ12, 第3のD/Aコンバー タ11)、とから構成されている光ディスク駆動装置で

### 【0032】第2の実施の形態

この第2の実施の形態は、請求項2の発明に対応してい るが、請求項1と請求項3の発明にも関連している。先 の第1の実施の形態では、結晶化レベルPeの駆動時に は、読み出しレベルPrの電流Irに結晶化レベルPe の電流 I e を重畳し、非晶質化レベル P p の駆動時に は、読み出しレベルPrの電流Irと結晶化レベルPe の電流Ieに、非晶質化レベルPpの電流Ipを重畳す ることによって、フォトディテクタ、検出アンプの検出 帯域が比較的狭くて安価な出射光量検出器を使用した簡 単な構成で、読み出しレベルPr、結晶化レベルPe、 非晶質化レベルPpの各出射レーザパワーの正確な検出 を可能にし、レーザダイオードの出射光量を安定化させ る場合について説明した。この第2の実施の形態では、 第1の実施の形態で説明した光ディスク駆動装置におい て、読み出しレベルPrの電流Irと、結晶化レベルP eの電流 I eの調整が具体的に行えるように構成した点 に特徴を有している。

【0033】ハード構成は、先の図1と同様であり、また、タイミングチャートも、先の図2と基本的に同様である。簡単にいえば、先の図1の光ディスク駆動装置において、第1のコンパレータ13とマイクロコントローラ12と第1のD/Aコンバータ9(第1調整手段)が、第5のD/Aコンバータ16から出力される所定電圧Trと第1のサンプルホールド回路17の出力レベルとを比較し、比較結果に応じて読み出しレベルPrの電流Irを増減させ、第2のコンパレータ14とマイクロコントローラ12と第2のD/Aコンバータ10(第250

調整手段)が、第4のD/Aコンバータ15から出力される所定電圧Teと第2のサンプルホールド回路18の出力レベルとを比較し、比較結果に応じて結晶化レベルPeの電流Ieを増減させる構成である。

12

【0034】図2に示したSHeは、情報コードCが「0」レベルの期間(図2の期間c)に出力されるサンプルタイミング信号SHeである。第2のタイミング回路25は、情報コードCが「0」レベルの期間(図2の期間a)に、サンプルタイミング信号SHeを出力する。第2のサンプルホールド回路18は、サンプルタイミング信号SHeに対応して光量検出電圧Vdをサンプリングする。その結果、第2のサンプルホールド回路18の出力には、常に結晶化レベルPeに比例した検出電圧が得られる。

【0035】マイクロコントローラ12は、予め、第4のD/Aコンバータ15を介して、レーザパワーが所望の結晶化レベルとなった場合に検出される検出電圧に等しい所定電圧Teを、第2のコンパレータ14の一方の入力端子に入力しておく。第2のコンパレータ14は、第2のサンプルホールド回路18の出力を、先の所定電圧Teと比較し、結晶化レベルPeが所望のレベルより低いときは「H」レベルの出力、高いときには「L」レベルの出力を発生する。マイクロコントローラ12は、第2のコンパレータ14の出力レベルを読み取り、

「H」レベルのときは、第2のD/Aコンバータ10の設定値を増加させ、Ie電流源7がレーザダイオード1に印加する電流 Iを増加させる。逆に、「L」レベルのときは、第2のD/Aコンバータ10の設定値を減少させて、Ie電流源7がレーザダイオード1に印加する電流 Iを減少させる。

【0036】このようなマイクロコントローラ12の制御によって、第2のコンパレータ14の出力の読み取りと、読み取り結果に応じた第2のD/Aコンバータ10の設定値とを、所定時間ごと(例えば10msecごと)に繰り返し行う。したがって、レーザダイオード1に印加される電流Iが制御され、レーザパワーの結晶化レベルPeが所望のレベルに調整される。しかしながら、すでに述べたように、フォトディテクタ2、アンプ3の応答帯域は限られているため、情報コードCが「1」レベルの期間(図2の期間b)のパルス状の発光部分では正確な光量検出ができない。そのため、図2の期間bの「1」レベルの間に、光量検出電圧Vdには、読み出しレベルPrや、非晶質化レベルPpに比例した検出レベルは現われない。

【0037】そこで、第2の実施の形態では、マイクロコントローラ12が、所定時間ごと(例えば1secごと)に、第1のタイミング回路24に対してサンプリング発生要求信号を出力する。第1のタイミング回路24は、このサンプリング発生要求信号を受信すると、所定の時間幅を有するサンプルタイミング信号SHrを出力

する。図2のSHrは、期間cに、サンプルタイミング 信号SHrが出力された状態を示している。第1のタイ ミング回路24から出力されたサンプルタイミング信号 SH r は、インバータ21を通過した後、2つのアンド ゲート回路、すなわち、第1のアンドゲート回路19と 第2のアンドゲート回路20の他方の入力へ与えられ る。したがって、サンプルタイミング信号SHrが、期 間cで「H」レベルとなると、情報コードCの状態に関 係なく、オン/オフ制御信号SWe, SWpは共に

13

「L」レベルとなる。そのため、Ieスイッチ6とIp 10 スイッチ4は共にオフ状態となり、レーザダイオード1 には電流Irのみが印加されるので、レーザダイオード 1のレーザパワー(出射レベル) Pは、読み出しレベル Prとなる。

【0038】また、この第1のタイミング回路24から 出力されるサンプルタイミング信号SHrは、第1のサ ンプルホールド回路17にも入力される。第1のサンプ ルホールド回路17は、サンプルタイミング信号SHr に対応して、光量検出電圧Vdをサンプリングする。こ の場合には、第1のサンプルホールド回路17の出力 は、読み出しレベルPrに比例した検出電圧として検知 される。このように、所定時間ごとに、レーザダイオー ド1の出射レベルを非パルス状に読み出しレベルPrと し、この期間 c に、光量検出電圧 V d をサンプリングす ることによって、読み出しレベルPrを検出することが 可能となる。

【0039】詳しくいえば、マイクロコントローラ12 は、予め、第5のD/Aコンバータ16を介して、レー ザパワーが所望の読み出しレベルPrとなった場合に検 出される検出電圧に等しい所定電圧Trを、第1のコン パレータ13の一方の入力端子に入力しておく。第1の コンパレータ13は、第1のサンプルホールド回路17 の出力を、この所定電圧Trと比較し、読み出しレベル Prが所望のレベルより低いときには「H」レベル、高 いときには「L」レベルを出力する。マイクロコントロ ーラ12は、サンプリング発生要求信号を出力し、第1 のサンプルホールド回路17によって光量検出電圧(ア ンプ3の出射光量検出電圧 V d) のサンプリングが行わ れた後、第1のコンパレータ13の出力レベルを読み取 り、「H」レベルのときは、第1のD/Aコンバータ9 の設定値を増加させて、 Ir電流源8からレーザダイオ ード1に印加する電流 I を増加させる。

【0040】逆に、「L」レベルのときは、第1のD/ Aコンバータ9の設定値を減少させて、Ir電流源8か らレーザダイオード1に印加する電流 I を減少させる。 このようなマイクロコントローラ12の制御によって、 サンプリング発生要求信号の出力、第1のコンパレータ 13の出力レベルの読み取り、読み取り結果に応じた第 1のD/Aコンバータ9の設定を、所定時間ごと(例え ば10msecごと)に繰り返し行う。したがって、レ 50 線、Ith1とIth2は雷流のしきい値を示す。

ーザダイオード1に印加される電流 I が制御され、レー ザパワーの結晶化レベルPeが所望のレベルに調整され る。

14

【0041】ここで、この第2の実施の形態を、先の図 1に示した光ディスク駆動装置と対比すれば、第1調整 手段(第1のコンパレータ13,マイクロコントローラ 12, 第1のD/Aコンバータ9)は、第1の所定レベ ル信号(第5のD/Aコンバータ16から出力される所 定電圧Tr)と第1のサンプルホールド手段(第1のサ ンプルホールド回路17)の出力レベルとを比較し、比 較結果に応じて第1レベルの電流(読み出しレベルPェ の電流 Іг) を増減させ、第2調整手段(第2のコンパ レータ14, マイクロコントローラ12, 第2のD/A コンバータ10)は、第2の所定レベル信号(第4のD /Aコンバータ15から出力される所定電圧Te)と第 2のサンプルホールド手段(第2のサンプルホールド回 路18)の出力レベルとを比較し、比較結果に応じて第 2 レベルの電流 (結晶化レベル P e の電流 I e ) を増減 させる構成である。

#### 【0042】第3の実施の形態 20

この第3の実施の形態は、請求項3の発明に対応してい るが、請求項1と請求項2の発明にも関連している。先 の第2の実施の形態では、読み出しレベルPrの電流 I rと、結晶化レベルPeの電流Ieとを調整するための 具体的な構成について説明した。この第3の実施の形態 では、さらに、非晶質化レベルPpの電流Ipを調整す る点に特徴を有している。

【0043】ハード構成は、先の図1と同様であり、ま た、タイミングチャートも、先の図2と基本的に同様で ある。図2に示したSHrは、期間cに出力されるサン プルタイミング信号SHrである。マイクロコントロー ラ12は、先の第2の実施の形態で述べたように、結晶 化レベルPeの調整動作に従って、第2のコンパレータ 14の出力レベルを読み取り、読み取り結果に応じた第 2のD/Aコンバータ10の設定を、所定時間ごと(例 えば10msecごと)に繰り返し行い、レーザパワー の結晶化レベルPeを所望のレベルに調整する。また、 マイクロコントローラ12は、第2のD/Aコンバータ 10に対する設定値に、所定比率を掛けた設定値を第3 のD/Aコンバータ11に設定する。その結果、非晶質 化レベルPpの駆動時に、Ip電流源5がレーザダイオ ード1に印加する電流 I pは、I e電流源7が印加する 電流Ieに所定比率を掛けた値となる。この関係を、次 に図3によって説明する。

【0044】図3は、図1に示した光ディスク駆動装置 について、第3の実施の形態によるレーザダイオード1 の電流IとレーザパワーPとの関係を示す特性図であ る。図の横軸はレーザダイオード1の電流 I、縦軸はレ ーザパワーPであり、 $\mathbf{O}$ と $\mathbf{O}$ はそれぞれ異なる特性曲

調整を行うタイマ割り込み処理Aについて、フローチャートで説明する。

【0045】この図3に示すように、レーザダイオード 1の電流 I とパワーPの特性は、周囲温度等の影響によ って、特性曲線 $\mathbf{0}$ や $\mathbf{0}$ のように変化する。しかし、しき い値電流 Ith 1, Ith 2以上では、ほぼ直線的な特性で ある。そこで、特性曲線の傾きが変化しても、読み出し レベルPrの電流Irと、結晶化レベルPeの電流Ie は、それぞれ一定のレベルが得られるように調整してお く。この場合に、非晶質化レベルPpの電流Ipを、結 晶化レベルPeの電流Ieに対して一定の比率に調整し ておけば、レーザダイオード1に電流1r+1e+1p 10 が印加された場合、一定の出射レベルPpが得られる。 【0046】以上のように、この第3の実施の形態で は、非晶質化レベルPpの電流Ipと結晶化レベルPe の電流Ieとの比率を、所望の非晶質化レベルPpが得 られるような値に予め設定しておく。したがって、所望 の非晶質化レベルP pが得られるようにしている。以上 に説明した非晶質化レベルPpの電流Ipの調整時の動

作を、フローチャートで説明する。 【0047】図4は、この発明の光ディスク駆動装置に ついて、レーザパワーの制御時における主要な処理の流 20 れを示すフローチャートである。図において、#1~# 5はステップを示す。

【0048】 このレーザパワーの制御は、図1のマイクロコントローラ12によって実行される。ステップ#1で、所望のレーザパワーの結晶化レベルPeと読み出しレベルPrに対応する所定電圧を発生する第4のD/Aコンバータ15と、第5のD/Aコンバータ16の初期設定を行う。この第4と第5のD/Aコンバータ15、16には、先に述べたように、それぞれ出力電圧が所定電圧Te、Trとなるようなデータが設定される。ステップ#2で、電流Ir, Ie, Ipの各電流源8, 7, 5の電流値を調整する第1から第3のD/Aコンバータ9~11の初期設定を行う。ここで、初期値は、例えば「0」などの値である。

【0049】ステップ#3で、次の図5のフローに示すタイマ割り込み処理Aの起動間隔を設定する。このタイマ割り込み処理Aの起動間隔は、例えば10 m s e c に設定され、以降、10 m s e c に設定され、以降、10 m s e c ごとにタイマ割り込みが発生し、割り込みごとにタイマ割り込み処理Aが起動 40 される。ステップ#4で、後出の図6のフローに示すタイマ割り込み処理Bの起動間隔を設定する。この割り込み処理Bの起動間隔は、例えば1 s e c に設定され、以降、1 s e c ごとにタイマ割り込みが発生し、割り込みごとにタイマ割り込み処理Bが起動される。

【0050】ステップ#5で、レーザパワー制御を継続するか否かチェックする。このチェックは、図4のフロー終了まで、ステップ#5をループするが、実際の処理においては、ループ中にタイマ割り込み処理A, Bが設定時間ごとに起動される。次に、電流Ie、電流Ipの50

【0051】図5は、図4に示したタイマ割り込み処理 Aについて、詳細な処理の流れを示すフローチャートで ある。図において、#11~#15はステップを示す。 【0052】タイマ割り込み処理Aが起動されると、ス テップ#11で、第2のコンパレータ14の出力レベル が読み込まれる。第2のコンパレータ14の出力レベル は、先に述べたように、結晶化レベルPeが所望のレベ ルより低いときは「H」レベルであり、高いときは 「L」レベルである。ステップ#12で、第2のコンパ レータ14の出力レベルが判定され、「H」レベルのと きは、ステップ#13に進み、Ie電流源7の電流値を 調整する第2のD/Aコンバータ10の設定値を更新す る。ステップ#13で、すでに設定された第2のD/A コンバータ10に対する設定値に「1」を加えた値が再 設定される。この結果、電流値Ieが増加されて、結晶 化レベルPeは上昇する。

【0053】また、出力レベルを判定した結果、「L」レベルのときは、ステップ#14へ進む。ステップ#14では、すでに設定された第2のD/Aコンバータ10に対する設定値から「1」を引いた値が再設定される。この結果、電流値Ieが減少されて、結晶化レベルPe は低下する。

【0054】ステップ#15では、Ip電流源5の電流値を調整する第3のD/Aコンバータ11の設定値を更新する。第3のD/Aコンバータ11には、先のステップ#13やステップ#14で第2のD/Aコンバータ1.0に対して設定された値に、所定係数Kを掛けた値を設定する。この係数Kを、所望の非晶質化レベルPpが得られるような値に予め決めておくことによって、所望の非晶質化レベルPpが得られる。以上のステップ#11~#15の処理によって、結晶化レベルPeの電流Ieと、非晶質化レベルPpの電流Ipが、所望の値に調整され、所望の非晶質化レベルPpのパワーが得られる。最後に、電流Irの調整を行うタイマ割り込み処理Bについて、フローチャートで説明する。

【0055】図6は、図4に示したタイマ割り込み処理 について、詳細な処理の流れを示すフローチャートであ る。図において、#21~#26はステップを示す。

【0056】先の図4のタイマ割り込み処理Bが起動されると、ステップ#21で、マイクロコントローラ12は、第1のタイミング回路24に対してサンプリング発生要求信号を出力する。ステップ#22では、第1のタイミング回路24がサンプルタイミング信号SHrを出力し、第1のサンプルホールド回路17が検出電圧Vdのサンプリングを行うまで、時間待ち(待機状態)となる。ステップ#23で、第1のコンパレータ13の出力レベルが読み込まれる。この第1のコンパレータ13の出力レベルは、先に述べたように、読み出しレベルPr

が所望のレベルより低いときは「H」レベルであり、高いときは「L」レベルである。ステップ#24で、第1のコンパレータ13の出力レベルが判定され、「H」のときは、ステップ#25へ進み、Ir電流源8の電流値を調整する第1のD/Aコンバータ9の設定値を更新する。

【0057】ステップ#25では、すでに設定された第1のD/Aコンバータ9に対する設定値に「1」を加えた値を再設定する。この結果、電流値 I r が増加されて、読み出しレベルP r は上昇する。また、出力レベル10を判定した結果、「I」レベルのときは、ステップ#26へ進む。ステップ#26では、すでに設定された第1のD/Aコンバータ9に対する設定値から「I」を引いた値を再設定する。この結果、電流値 I r が減少されて、読み出しレベルI r は低下する。

【0058】ここで、この第3の実施の形態を、先の図 1に示した光ディスク駆動装置と対比すれば、第2の実 施の形態で説明した光ディスク駆動装置において、第3 調整手段(第2のコンパレータ14、マイクロコントロ ーラ12, 第3のD/Aコンバータ11)は、第3レベ 20 ルの電流(非晶質化レベルPpの電流 Ip)が、第2調 整手段(第2のコンパレータ14、マイクロコントロー ラ12, 第2のD/Aコンバータ10) によって調整さ れた第2レベルの電流(結晶化レベルPeの電流 Ie) に比例した値となるように調整するように構成してい る。したがって、非晶質化レベルPpのレーザパワーに ついては直接検出を行わないが、調整された電流Ie に、所定比率(例えば係数K)を掛けた電流 I pを印加 するように制御するので、非晶質化レベルPpを所望レ ベルに正確に調整することが可能になり、記録される情 30 報の信頼性を向上させることができる。

#### 【0059】第4の実施の形態

この第4の実施の形態は、請求項4の発明に対応しているが、請求項1の発明にも関連している。この第4の実施の形態では、先の第1の実施の形態で説明した光ディスク駆動装置において、第2のサンプルホールド回路18が、1eスイッチ6のオン/オフ制御信号SWpがオフ状態で、1pスイッチ4のオン/オフ制御信号SWpがオフ状態の期間が所定期間以上となる期間中のアンプ3の出射光量検出電圧Vdを保持する点に特徴を有して40いる。ハード構成は、先の図1と同様であり、また、タイミングチャートも、先の図2と基本的に同様である。先の図1に示した第2のタイミング回路25は、情報コードCが「0」レベルの期間(図2の期間a)が所定期間以上となる場合だけ、サンプルタイミング信号SHeを出力する。

【0060】図7は、図1に示した光ディスク駆動装置について、第4の実施の形態による第2のタイミング回路25の動作を説明するタイミングチャートである。図の各波形に付けられた符号は図2と同様であり、a1~

a5は情報コードCが「O」レベルの期間を示す。

18

【0061】この図7には、情報コードCが「0」レベ ルの期間が5T以上のとき、第2のタイミング回路25 がサンプルタイミング信号SHeを出力する場合を示し ている。図7の場合には、情報コードCが「O」レベル の期間は、a1からa5までの5つの期間であるが、こ れらの期間a1~a5の内、「O」レベルの期間が5T 以上は、期間 a 3 (5 T) と期間 a 5 (6 T) の部分だ けである。したがって、サンプルタイミング信号SHe は、図7のSHeに示すように、期間a3と期間a5に 出力されることになる。この図7には、Vdとして、光 量検出電圧Vdの波形も示している。従来の装置では、 フォトディテクタ2やアンプ3の検出帯域が比較的低い 場合には、情報コードCが「O」レベルの期間、すなわ ち、レーザパワーが結晶化レベルPeで非パルス状とな っている状態でも、その期間が短いときは、光量検出電 圧Vdの整定が十分に行われず、結晶化レベルPeに比 例した電圧が検出できない場合がある。しかし、その期 間が十分に長いときは、光量検出電圧Vdの整定が十分 に行われ、結晶化レベルPeに比例した電圧が検出可能 である。

【0062】この第4の実施の形態では、光量検出電圧 V dが十分に整定するように、情報コードCの「O」レ ベルの期間が所定期間以上となる場合だけ、サンプルタ イミング信号SHeが出力されるので、第2のサンプル ホールド回路18には、結晶化レベルPeに比例した検 出電圧がサンプリングされる。その結果、第4の実施の 形態によれば、レーザパワーが非パルス状となる部分 で、しかも、所定期間以上の情報コードCの「0」レベ ルの期間に、光量検出電圧をサンプリングしているの で、光量検出電圧が充分に整定する期間だけサンプルタ イミング信号が出力されることになり、先の第1の実施 の形態に比べて、一層正確な結晶化レベルPeの検出が 可能になる。ここで、この第4の実施の形態を、図1に 示した光ディスク駆動装置と対比すれば、第2のサンプ ルホールド手段(第2のサンプルホールド回路18) は、第1のオン/オフ制御信号(Ieスイッチ6のオン /オフ制御信号SWe)がオン状態で、第2のオン/オ フ制御信号(Ipスイッチ4のオン/オフ制御信号SW p) がオフ状態の期間が所定期間以上となる期間中の光 量検出手段(フォトディテクタ2、アンプ3)の出力 (Vd)を保持する構成である。

### 【0063】第5の実施の形態

この第5の実施の形態は、請求項5の発明に対応しているが、請求項1の発明にも関連している。この第5の実施の形態では、先の第1の実施の形態で説明した光ディスク駆動装置において、第2のサンプルホールド回路18が、1eスイッチ6のオン/オフ制御信号SWeがオン状態で、1pスイッチ4のオン/オフ制御信号SWpがオフ状態の内、記録コードの最長反転期間に相当する

期間だけ、アンプ3の出射光量検出電圧 V d を保持する点に特徴を有している。ハード構成は、先の図1と同様であり、また、タイミングチャートも、先の図2と基本的に同様である。先の図1に示した第2のタイミング回路25は、情報コードCが「0」レベルの期間(図2の期間 a)の内、情報コードの最大反転間隔に相当する期間だけ、サンプルタイミング信号 S H e を出力する。

【0064】図8は、図1に示した光ディスク駆動装置について、第5の実施の形態による第2のタイミング回路25の動作を説明するタイミングチャートである。図の各波形に付けられた符号は図2と同様である。

【0065】この図8には、CDのEFMフレームフォーマットを示している。情報コード(記録コード)にEFM変調されたコードを使用する場合、1EFMフレームは、588チャネルビットから構成されている。そして、最初に、24チャネルビットの同期パタンが記録されている。このようなCDのフォーマットでは、最大反転間隔である11Tの情報コードCが「0」の期間は、各EFMフレームに挿入されている同期パタン部において必ず出現する。この同期パタン部において、情報コードCは、下方に示すように、11Tで反転される。

【0066】第2のタイミング回路25は、その反転間隔が、最小3Tから最大11Tまでに設定されている。そのため、第2のタイミング回路25は、この情報コードCが「0」レベルの期間の内、最大反転間隔に相当する期間だけ、サンプルタイミング信号SHeを出力する。すなわち、サンプルタイミング信号SHeは、図8のSHeに示すように、反転間隔が11Tの期間に出力されることになる。したがって、第2のサンプルホールド回路18には、結晶化レベルPeに比例した検出電圧30がサンプリングされることになり、フォトディテクタ、検出アンプの帯域が限られている場合でも、結晶化レベルPeの出射レーザパワーを正確に検出することができる。

【0067】以上のように、この第5の実施の形態は、 先の第4の実施の形態の光ディスク駆動装置と同様に、 アンプ3の出射光量検出電圧Vdが十分に整定するよう に、情報コードCの「0」レベルの期間が最大反転間隔 に相当する期間だけ、サンプルタイミング信号SHeが 出力される。その結果、第5の実施の形態によれば、レ 40 ーザパワーが非パルス状となる部分で、しかも、最大反 転間隔に相当する期間に、光量検出電圧をサンプリング しているので、光量検出電圧が充分に整定する期間だけ サンプルタイミング信号が出力されることになり、先の 第1の実施の形態に比べて、より正確に結晶化レベルP eを検出することが可能になる。ここで、この第5の実 施の形態を、図1に示した光ディスク駆動装置と対比す れば、第2のサンプルホールド手段(第2のサンプルホ ールド回路18)は、第1のオン/オフ制御信号(Ie スイッチ6のオン/オフ制御信号SWe)がオン状態

で、第2のオン/オフ制御信号(Ipスイッチ4のオン/オフ制御信号SWp)がオフ状態の内、記録コードの最長反転期間に相当する期間の光量検出手段(フォトディテクタ2、アンプ3)の出力(Vd)を保持する構成である。

### [0068]

【発明の効果】請求項1の光ディスク駆動装置では、結 晶化レベルPeの駆動時には、読み出しレベルPrの電 流Irに結晶化レベルPeの電流Ieを重畳し、非晶質 化レベルPpの駆動時には、読み出しレベルPrの電流 Irと結晶化レベルPeの電流Ieに、非晶質化レベル Ppの電流 Ipを重畳するようにしている。具体的にい えば、読み出しレベルPrは、所定時間ごとに、レーザ ダイオードの出射レベルを非パルス状に読み出しレベル Prとし、この期間で光量検出電圧をサンプリングする ことにより、正確な読み出しレベルPrを検出する。そ して、正確に検出された各レベルに基づいてレーザダイ オードへの印加電流 Ir、Ieの調整を行う。したがっ て、フォトディテクタ、検出アンプの検出帯域が比較的 狭く、安価な出射光量検出器を使用する場合でも、結晶 化レベルPe、読み出しレベルPrの各出射レーザパワ 一の正確な検出が可能になる。その結果、レーザダイオ ードを結晶化レベルPe、読み出しレベルPrのそれぞ れ所望のレベルに正確に調整することができ、出射光量 の安定化が可能になるので、記録される情報の信頼性を 向上させることができる。

【0069】請求項2の光ディスク駆動装置では、請求項1の駆動装置において、読み出しレベルPrの電流Irと、結晶化レベルPeの電流Ieを調整するための手段を具体的に構成している。具体的には、結晶化レベルPeは、情報コードCが「0」レベルの期間において、レーザパワーが非パルス状となる部分で、光量検出電圧をサンプリングすることにより、正確な結晶化レベルPeが検出される。したがって、請求項1の駆動装置による効果に加えて、レーザダイオードに印加される電流Iが制御され、レーザパワーの結晶化レベルPeを所望のレベルに調整することができる。

【0070】請求項3の光ディスク駆動装置では、請求項2の駆動装置において、非晶質化レベルPpの電流Ipを調整するようにしている。具体的にいえば、非晶質化レベルPpの電流Ipと結晶化レベルPpが得られるような値に予め設定しておく。この場合には、非晶質化レベルPpの出射レーザパワーは直接検出しないが、調整された電流Ieに所定比率を掛けた電流Ipが印加される。したがって、請求項2の駆動装置による効果に加えて、非晶質化レベルPpを所望のレベルに正確に調整することができる。

【0071】請求項4の光ディスク駆動装置では、請求 50 項1の駆動装置において、光量検出電圧Vdが十分に整

定するように、情報コードCの「0」レベルの期間が所定期間以上となる場合だけ、サンプルタイミング信号(SHe)が出力されるので、結晶化レベルPeに比例した検出電圧をサンプリングすることができる。具体的には、レーザパワーが非パルス状となる部分で、しかも、所定期間以上の情報コードCの「0」レベルの期間に、光量検出電圧をサンプリングしているので、光量検出電圧が充分に整定する期間だけサンプルタイミング信号が出力される。したがって、請求項1の駆動装置による効果に加えて、一層正確な結晶化レベルPeの検出が可能になる。

【0072】請求項5の光ディスク駆動装置では、請求項1の駆動装置において、光量検出電圧Vdが十分に整定するように、情報コードCの「0」レベルの期間が最大反転間隔に相当する期間だけ、サンプルタイミング信号(SHe)が出力されるので、結晶化レベルPeに比例した検出電圧をサンプリングすることができる。具体的には、レーザパワーが非パルス状となる部分で、しかも、最大反転間隔に相当する期間に、光量検出電圧をサンプリングしているので、光量検出電圧が充分に整定する期間だけサンプルタイミング信号が出力される。したがって、請求項1の駆動装置による効果に加えて、より正確に結晶化レベルPeを検出することが可能になる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の光ディスク駆動装置について、そのレーザパワー制御装置の要部構成の実施の形態の一例を示す機能ブロック図である。

【図2】図1に示した光ディスク駆動装置について、その動作を説明するタイミングチャートである。

【図3】図1に示した光ディスク駆動装置について、第 30 3の実施の形態によるレーザダイオード1の電流 I とレーザパワーPとの関係を示す特性図である。 \*

\*【図4】この発明の光ディスク駆動装置について、レーザパワーの制御時における主要な処理の流れを示すフローチャートである。

【図5】図4に示したタイマ割り込み処理Aについて、 詳細な処理の流れを示すフローチャートである。

【図6】図4に示したタイマ割り込み処理について、詳細な処理の流れを示すフローチャートである。

【図7】図1に示した光ディスク駆動装置について、第4の実施の形態による第2のタイミング回路25の動作を説明するタイミングチャートである。

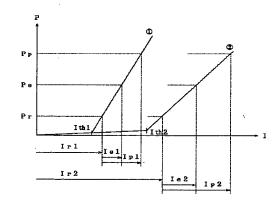
【図8】図1に示した光ディスク駆動装置について、第5の実施の形態による第2のタイミング回路25の動作を説明するタイミングチャートである。

【図9】相変化型光ディスクにおける記録方法の原理を 説明する図である。

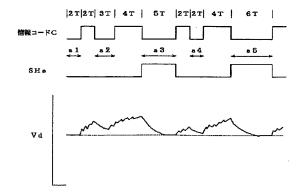
## 【符号の説明】

1 ……レーザダイオード、2 ……フォトディテクタ、3 ……アンプ、4 …… I pスイッチ、5 …… I p電流源、6 …… I eスイッチ、7 …… I e電流源、8 …… I r電流源、9 ……第1のD/Aコンバータ、10 ……第2のD/Aコンバータ、11 ……第3のD/Aコンバータ、12 ……マイクロコントローラ、13 ……第1のコンパレータ、14 ……第2のコンパレータ、15 ……第4のD/Aコンバータ、16 ……第5のD/Aコンバータ、17 ……第1のサンプルホールド回路、18 ……第2のサンプルホールド回路、19 ……第1のアンドゲート回路、20 ……第2のアンドゲート回路、21 ……インバータ、22 ……第1のパルスジェネレータ、23 ……第2のパルスジェネレータ、24 ……第1のタイミング回路、25 ……第2のタイミング回路、26 ……エンコーダ

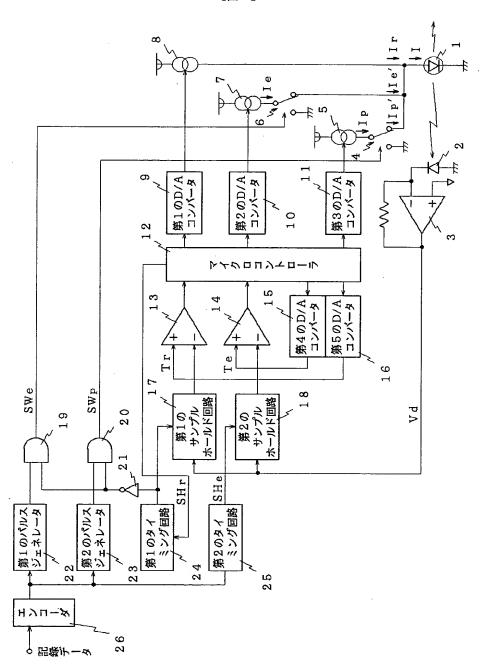
[図3]

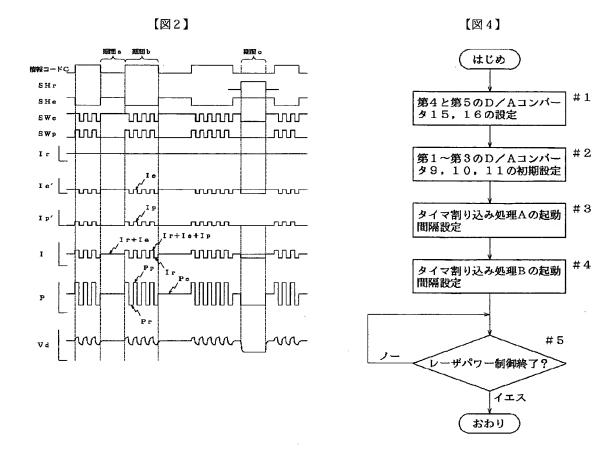


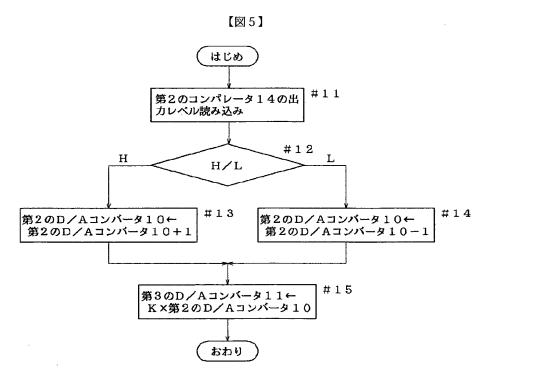
[図7]

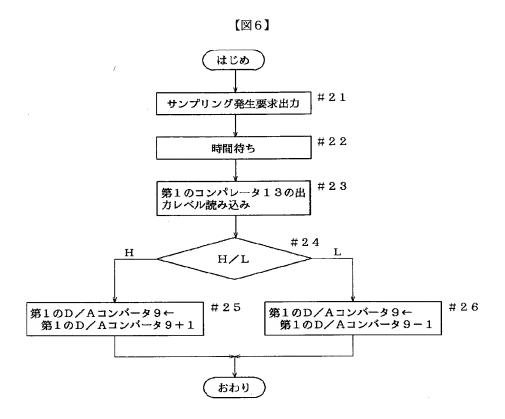


【図1】









[図8]

